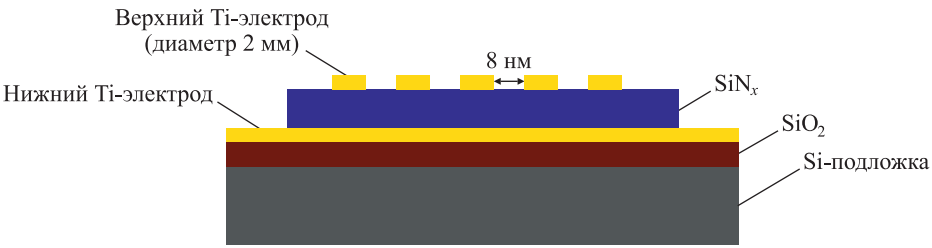

Рис. 1. Тестовая МДП-структура для измерения пробивного напряжения

Fig. 1. Metal – dielectric – semiconductor test structure for breakdown voltage measurement